

Development of Finishing Process of MgF₂ Surfaces for a Far Ultraviolet Schmidt Camera

田口 真 [1]; 中村 哲也 [1]

Makoto Taguchi[1]; Tetsuya Nakamura[1]

[1] 立教大

[1] Rikkyo Univ.

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。